

国際粉体工業展東京 2010 出展報告

開催日時	2010年12月1日(水)~3日(金) 10:00~17:00
会場	東京ビッグサイト 東ホール 東京都江東区有明 3-11-1 製品展示ブース: Q-09
展示製品	X線透過式沈降式粒度分布測定装置 SediGraph 高精度粒度分布測定装置 Elzone II 5390 フロー式画像解析粒子径・形状測定装置 Particle Insight レーザー回折散乱式粒度分布測定装置 Saturn DigiSizer II かさ密度測定装置 GeoPyc 1360

12月1日~3日間に、ビッグサイトにて国際粉体工業展が開催されました。

多くのお客様が展示会に来場され、マイクロメリティックスジャパンブースにもたくさんのお客様にお越しいただきました。誠に有難うございました。

当社は、粒子物性分野において品質管理と研究開発に必要とする全ての測定装置を提供しております。今回始めて国際粉体工業展を通じて、日本のお客様にお目にかかり、下記のソリューションをご提案いたしました。

- ✓ オイルを使用せず、環境に優しいかさ密度測定法
- ✓ 粒子画像を撮影し、粒子径のみならず粒子形状を測定
- ✓ 世界で最も多いディテクターを搭載したレーザー回折散乱法粒度分布測定装置
- ✓ 粒子形状の影響を受けずに高精度で測定できるX線透過式沈降式
- ✓ 粒子の形状を受けない三次元測定法の電気的検知帯方法

